

具有體積全像光導元件之光譜儀系統

習知光譜儀架構系統P100中，必須使用狹縫P10增加待測光源40之空間同調性，光線經過狹縫後，藉由一繞射薄光柵P11，將不同波長之光線分離，並分別照射在感測元件50上，透過讀取不同位置之讀數，即可判斷待測光源40之光譜。然而此架構中，使用之狹縫P10限縮進光量，以及薄光柵P11效率較低，會使得習知光譜儀架構系統P100之能量運用效率較低，致使量測較弱光源時產生困難。

本發明為一種具有體積全像光導元件之光譜儀系統，其主要係要解決習知光譜儀架構系統之能量運用效率較低，致使量測較弱光源時產生困難...等問題，此外、此系統亦可用於量測面光源之均勻度。

◆ 優點：

藉由本發明之實施，至少可以達成下列之進步功效：

- 一、 能量運用效率高於傳統光譜儀，且更適用於量測較弱的光源。
- 二、 可量測點光源與均勻面光源之光譜外，亦可量測任一光源之光譜。
- 三、 可量測光源之強度均勻度與色彩均勻度。

